



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE L'ESSONNE

DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE  
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

10 boulevard de France 91010 ÉVRY Cedex

## ARRÊTÉ

N° 2009.PREF.DCI2/BE 0174 du

06 NOV. 2009

portant imposition de prescriptions complémentaires à la Société ALTIS SEMICONDUCTOR  
située 224 boulevard John Kennedy 91100 CORBEIL-ESSONNES

**LE PREFET DE L'ESSONNE,**  
**Chevalier de la Légion d'Honneur,**  
**Chevalier de l'Ordre National du Mérite,**

VU le code de l'environnement, et notamment les articles R.512-31 et R.512-45,

VU le code de la santé publique,

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,

VU le décret du 16 mai 2008 portant nomination de M. Jacques REILLER, préfet, en qualité de Préfet de l'Essonne,

VU la directive Européenne 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution dite « IPPC »,

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie approuvé par arrêté interpréfectoral n° 96.1868 du 20 septembre 1996,

VU l'arrêté ministériel du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par l'article R.512-45 du Code de l'Environnement,

VU l'arrêté n° 2009-PREF-DCI/2-036 du 11 septembre 2009 portant délégation de signature à Monsieur Pascal SANJUAN, Secrétaire Général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'Arrondissement Chef-lieu,

VU l'arrêté préfectoral n° 2004.PREF.DAI3/BE 0098 du 5 juillet 2004 autorisant la Société ALTIS SEMICONDUCTOR dont le siège social se situe 224 boulevard John Kennedy 91100 CORBEIL-ESSONNES, à exploiter à la même adresse les activités suivantes relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement :

- 1111.2 (A) : emploi ou stockage de substances ou préparations très toxiques.

Quantité de liquides très toxiques = 5,57 tonnes. Acide fluorhydrique (HF) en solution de concentration supérieure à 7%

- 1111.3. (A) : emploi ou stockage de substances ou préparations très toxiques.  
**Quantité stockée de gaz très toxiques = 2 tonnes. Hexafluorure de tungstène, trichlorure de bore.**
- 1131.2 (A): emploi ou stockage de substances ou préparations toxiques.  
**Quantité de liquides toxiques = 50 tonnes**
- 1131.3 (D) : emploi ou stockage de substances ou préparations toxiques.  
**Quantité de gaz toxiques = 800 kg**
- 1136.A.2 (D) : stockage de l'ammoniac en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg.  
**Quantité d'ammoniac stockée = 300 kg**
- 1136.B (D) : emploi d'ammoniac, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure ou égale à 1,5 t.  
**Quantité d'ammoniac employée = 1,3 tonnes**
- 1138.4 (A) : emploi ou stockage du chlore en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg.  
**Quantité de chlore = 520 kg**
- 1141.3 (A) : emploi ou stockage du chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié en récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg.  
**Quantité de chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié = 1,2 tonnes**
- 1150.6 (D) : substances et préparations toxiques particulières : phosphine.  
**Quantité de substances et préparation toxiques particulières (phosphine) = 30 kg**
- 1172 (D) : substances ou préparations dangereuses pour l'environnement.  
**Quantité de substances dangereuses pour l'environnement (ammoniac en solution aqueuse de 15 et 28%) = 35 tonnes**
- 1200.2 (D) : emploi ou stockage de substances ou préparations de comburants.  
**Quantité de substances ou préparations comburantes = 8,5 tonnes**
- 1220 (D) : emploi et stockage de l'oxygène.  
**Quantité d'oxygène = 48 tonnes**
- 1411 (D) : gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables.  
**Quantité de gazomètres et réservoirs de gaz comprimés contenant des gaz inflammables = 1,3 tonnes**
- 1416 (A) : stockage ou emploi de l'hydrogène..  
**Quantité d'hydrogène = 3,8 tonnes**
- 1418 (D) : stockage ou emploi de l'acétylène.  
**Quantité d'acétylène = 200 kg**
- 1432.2 (A) : stockage de liquides inflammables.  
**Quantité de liquides inflammables stockés en réservoirs manufacturés = 1<sup>ère</sup> catégorie : 235 m<sup>3</sup>, 2<sup>ème</sup> catégorie : 940 m<sup>3</sup>**
- 1433.B (A) : mélange ou d'emploi de liquides inflammables.  
**Quantité de liquides inflammables (mélange et emploi) = 18 tonnes (capacité équivalente 423 m<sup>3</sup>)**
- 1611 (A) : emploi ou stockage d'acides.  
**Quantité d'acides chlorhydrique, nitrique, sulfurique, phosphorique = 320 tonnes**
- 1630 (D) : emploi ou stockage de soude ou potasse caustique.  
**Quantité stockée de soude ou potasse caustique = 110 tonnes**

- 2910.A (A) : installation de combustion.

- ♦ Chauffage au gaz naturel = 75,5 MW
- ♦ Groupes de remplacement au fuel = 57,8 MW
- ♦ Groupes diesel de sécurité = 11,36 MW

- 2920.2 (A) : installations de réfrigération ou compression.

- ♦ Réfrigération = 27 065 kW
- ♦ Compression = 1 750 kW

- 2925 (D) : ateliers de charge d'accumulateurs.

Puissance installée = 13 005 kW.

VU l'arrêté préfectoral n° 2008.PREF.DCI3/BE 0136 du 12 septembre 2008 portant imposition de prescriptions complémentaires à la société ALTIS SEMICONDUCTOR sise 224 boulevard John Kennedy à CORBEIL-ESSONNES,

VU le bilan décennal de fonctionnement transmis par la Société ALTIS SEMICONDUCTOR le 13 février 2007 et complété le 28 janvier 2008,

VU le rapport de l'inspecteur des installations classées du 28 mai 2009,

VU l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 16 juin 2009 notifié le 22 juin 2009,

**CONSIDERANT** que le bilan décennal de fonctionnement transmis par la Société ALTIS SEMICONDUCTOR comprend l'ensemble des points demandés, à savoir la description du site et ses évolutions au regard de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la synthèse de la surveillance des émissions, la mise en évidence des faits marquants, l'analyse des performances des installations au regard des Meilleures Technologies Disponibles (MTD) et les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions,

**CONSIDERANT** que la Société ALTIS SEMICONDUCTOR a engagé des efforts sur la diminution de sa consommation d'eau ainsi que sur l'optimisation du recyclage,

**CONSIDERANT** qu'elle s'engage à poursuivre ses actions et à essayer de supprimer l'utilisation des eaux souterraines dans ses systèmes de refroidissement et que cet objectif est repris dans l'article 3 du présent arrêté,

**CONSIDERANT** que la Société ALTIS SEMICONDUCTOR s'engage à poursuivre la modernisation de ses tours aéroréfrigérantes en remplaçant les réseaux de canalisation en acier noir, des tours aéroréfrigérantes par de l'acier oxydable, en introduisant une nouvelle gestion des systèmes de refroidissement et en procédant à un suivi régulier de la corrosion des canalisations des tours, objectif figurant dans l'article 8 du présent arrêté,

**CONSIDERANT** que la Société ALTIS SEMICONDUCTOR ayant complété ses dispositifs de traitement des rejets gazeux, est cohérente vis-à-vis des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) et que l'article 6 du présent arrêté encadre ces modifications,

**CONSIDERANT** que la société ALTIS SEMICONDUCTOR souhaite optimiser la taille de l'équipe d'intervention au vu de la diminution du nombre d'interventions dues à des mesures organisationnelles mises en place et de la modernisation de son système de report des alarmes, objectif repris à l'article 7 du présent arrêté,

**CONSIDERANT** que la société ALTIS SEMICONDUCTOR doit tenir à disposition de l'inspection des installations classées les documents justifiant de l'utilisation d'un combustible à basse teneur en soufre (fuel),

**CONSIDERANT** la nécessité d'actualiser les prescriptions techniques figurant dans l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2004 délivré à la Société ALTIS SEMICONDUCTOR au regard de son bilan décennal de fonctionnement,

**CONSIDERANT** que les intérêts visés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement peuvent être prévenus par ces prescriptions techniques,

**SUR** proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

**ARRETE**

# TITRE 1

## ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Les prescriptions du présent arrêté modifient et complètent celles de l'arrêté préfectoral modifié n°2004.PREF.DAI3/BE 0098 en date du 5 juillet 2004 qui autorise la société ALTIS SEMICONDUCTOR, dont le siège social est situé 224 Boulevard John Kennedy 91105 CORBEIL-ESSONNES CEDEX, à exploiter des installations de production de circuits intégrés semi-conducteurs de très haute technologie sur les communes de CORBEIL ESSONNES et LE COUDRAY MONTCEAUX dans le département de l'Essonne.

## ARTICLE 2 : SITUATION ADMINISTRATIVE

L'article 2.1 du titre 1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°2004.PREF.DAI3/BE 0098 en date du 5 juillet 2004 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Désignation des activités	Eléments caractéristiques	Rubrique de la nomenclature	Régime AS/A/D
Très toxiques (emploi ou stockage de substances ou préparations)			
- liquides	5.7 tonnes acide fluorhydrique (HF) en solution de concentration supérieure à 7 %	1111-2	A
- gaz	2 tonnes (notamment l'hexafluorure de tungstène, le trichlorure de bore)	1111-3	A
Toxiques (emploi ou stockage de substances ou préparations)			
- liquides	50 tonnes	1131-2	A
- gaz	800 kg	1131-3	D
Ammoniac (emploi ou stockage)			
- stockage en capacités unitaires inférieures à 50 kg	300 kg	1136-A-2	DC
- emploi	1.3 tonnes	1136-B	DC
Chlore (emploi ou stockage) en capacités unitaires inférieures à 60 kg	520 kg	1138-4	A
Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage) en capacités unitaires inférieures à 37 kg	1.2 tonnes	1141-3	A
Substances et préparations toxiques particulières			
- phosphine	30 kg	1150-6	D

### ARTICLE 3 : COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Les articles 2.1 et 2.5 du chapitre I du titre 3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°2004.PREF.DAI3/BE 0098 en date du 5 juillet 2004 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

#### « 2.1 : NATURE DES EFFLUENTS

On distingue dans l'établissement :

- les eaux vannes et les eaux usées de lavabo, toilettes... (**EU**) qui comprennent également les effluents issus de la société SNDI relatifs au nettoyage des tenues de travail,
- les eaux pluviales (**EP**),
- les eaux pluviales issues des différentes aires de dépotage et diverses cuves de stockage (**EPbis**),
- les rétentats d'osmose inverse (**ROI**),
- les eaux usées de silice colloïdales (**EUSC**),
- Les eaux usées issues du rodage des tranches de silicium, (**EUSI**),
- les eaux de refroidissement et de purge ainsi que les surplus de bache d'eau (**ER**),
- les eaux usées désionisées recyclées (**EDUR**),
- les effluents industriels (**EI**) :
  - les effluents concentrés, dits **EUIC** correspondant aux rejets d'acides (notamment les acides nitrique, fluorhydrique, phosphorique, fluorure d'ammonium), bases et sels « toxiques », aux vidanges de toutes les capacités de produits chimiques, qu'ils soient concentrés, purs ou en mélange, ainsi qu'à la collecte des produits provenant des cuvettes de rétention associées au stockage de ces produits.
  - les effluents dilués, dits **EUID** provenant des bacs de rinçage et des séquences de rinçage des réacteurs de traitement des tranches de silicium, des dispositifs de rétention associés aux postes d'utilisation de produits chimiques, des équipements de sécurité mis à la disposition du personnel ainsi que de la vidange de ces équipements, à l'exception des **EUICN** et **EUICC**. Les **EUID** comprennent également les filtrats résultant du traitement des eaux chargées en silicium, les effluents issus du polissage des tranches, les effluents issus de la décarbonatation de l'eau de ville et de l'eau souterraine, les eaux issues de la production d'eau désionisée et d'eau de service, les purges de déconcentration des tours aéroréfrigérantes (**TAR**), les vidanges des **TAR**, des rejets d'acide chlorhydrique et sulfurique dilués, les eaux issues de l'épuration des **EUICN** (**EUICN<sub>epur</sub>**).
- les **EUICC** correspondent à tous les rejets contenant du chrome hexavalent concentrés ou dilués qui ne respectent pas les caractéristiques des **EUID**,
- les **EUICN** correspondent à tous les rejets d'ammoniaque non mélangé,
- les solvants organiques (**SMU**),
- les réseaux spécifiques (**RS**) collectant des effluents destinés à être éliminés en tant que déchet (notamment « mélange sulfate de cuivre et acide sulfurique » et « éthylène glycol + acide fluorhydrique »)

#### 2.5 MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'EAU

L'exploitant doit mettre en œuvre un programme d'action visant à réduire la consommation d'eau sur le site.

Ce programme s'attache particulièrement à viser le maximum de recyclage interne, en particulier celui des **EDUR** et à limiter l'utilisation de l'eau souterraine dans le cadre de l'alimentation des tours aéroréfrigérantes.

Le point c) de l'article 6.3 du chapitre 1 du titre 3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°2004.PREF.DAI3/BE 0098 en date du 5 juillet 2004 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« c/ rejets n°1 et 2, au raccordement en Seine

Paramètres	Concentration maximale (mg/l)	Autosurveillance assurée par l'exploitant	
MES	35	Moyen 24 h	Trimestrielle
DBO5	30	Moyen 24 h	Trimestrielle
DCO	125	Moyen 24 h	Trimestrielle
Hydrocarbures totaux	5	Moyen 24 h	Trimestrielle
pH		Continu lors de la mesure	Trimestrielle
Débit		Continu lors de la mesure	Trimestrielle

Pour l'autosurveillance des effluents EUIC et EUID, la mesure est effectuée en aval immédiat de leur station d'épuration. »

#### ARTICLE 6 :

Le tableau visé à l'article 2.2 du chapitre II du titre 3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°2004.PREF.DAI3/BE 0098 en date du 5 juillet 2004 est complété par les dispositions suivantes en gras:

Installations	Hauteur minimale des cheminées d'extraction en mètres	Vitesse minimale d'éjection des gaz en m/s	Nature des rejets	Traitements
Ateliers de fabrication (bâtiment B3)	Sans objet	Sans objet	Composés organiques volatils, à l'exception du méthane (COV)	Centralisé sur absorbeur et incinérateur électrique secouru par un incinérateur au gaz naturel
			[...]	[...]
			chrome	laveur de gaz au point d'utilisation
			gaz perfluorocarbonés	Installations individuelles comportant un brûleur et une tour de lavage

#### **ARTICLE 7 :**

Le deuxième alinéa de l'article 7.2.1 du chapitre V du titre 3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°2004.PREF.DAI3/BE 0098 en date du 5 juillet 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention constituée au minimum de 3 agents incendie présents en permanence sur le site dont un est au centre de sécurité visée à l'article 7.2.2 ci dessous. »

#### **ARTICLE 8 :**

L'alinéa 2 de l'article III-2 du chapitre III du titre 4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°2004.PREF.DAI3/BE 0098 en date du 5 juillet 2004 est complété par les dispositions suivantes :

« Les purges de déconcentration des tours aéroréfrigérantes sont asservies à la mesure de la résistivité.

Un suivi de l'état des canalisations des installations (corrosion...) est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Ce suivi est réalisé sur des installations ou parties d'installations représentatives de l'ensemble identifiées sur site. Un suivi des réactifs utilisés au niveau de la bache de récupération des EDUR doit être réalisé : les résultats de ce suivi sont également consignés dans le registre précité.

Les réseaux de canalisation en acier noir des tours aéroréfrigérantes doivent être remplacés par de l'acier inoxydable. Ce changement est réalisé lors de travaux importants de réfection menés sur une tour aéroréfrigérante ou lors de son remplacement. »

#### **ARTICLE 9 :**

Le chapitre V du titre 4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°2004.PREF.DAI3/BE 0098 en date du 5 juillet 2004 est complété par les dispositions suivantes :

« 10/ L'exploitant doit s'assurer de la faible teneur en soufre du fuel livré sur son site. Les documents justifiant de la faible teneur en soufre sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.»

#### **ARTICLE 10 :**

L'article 8 du titre 2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°2004.PREF.DAI3/BE 0098 en date du 5 juillet 2004 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Tous les documents répertoriés dans le présent arrêté sont conservés sur le site durant 5 années à la disposition de l'inspection des installations classées sauf réglementation particulière. »

#### **ARTICLE 11 :**

La valeur de la concentration en oxygène (3%) précisée dans le 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> tableau de l'article 3.2 du chapitre II du titre 2 est supprimée et remplacée par la valeur de 11%.

## TITRE 2

### RECOURS ET EXECUTION

#### **ARTICLE 1 : Délais et voies de recours - (Article L. 514-6 du code de l'Environnement)**

I. - Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES CEDEX) :

1°/ Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

2°/ Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.

II. - « Les dispositions du 2° du I » ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.

Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.

III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme."

#### **ARTICLE 2 : Exécution**

Le Secrétaire Général de la Préfecture,  
Le Maire de CORBEIL-ESSONNES,  
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,  
Le Directeur Départemental de l'Équipement,  
Le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,  
Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,  
Le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,  
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,  
Le Directeur Régional de l'Environnement d'Île-de-France,  
Les Inspecteurs des Installations Classées,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet,  
Le Secrétaire Général,

  
Pascal SANJUAN